

2024年8月15日

会社名 株式会社ブイ・テクノロジー
代表者 代表取締役兼社長執行役員 杉本 重人
(コード番号：7717 プライム市場)
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL：045-338-1980)

フォトマスク欠陥修正装置「Draco」を 国内大手フォトマスクメーカー様より受注いたしました。

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134横浜ビジネスパークイーストタワー9F 代表取締役兼社長執行役員 杉本 重人）は、国内大手フォトマスクメーカー様から、局所真空技術と収束イオンビームを用いた世界初のフォトマスク欠陥修正装置「Draco(ドラコ)」を受注いたしましたので、ご案内いたします。

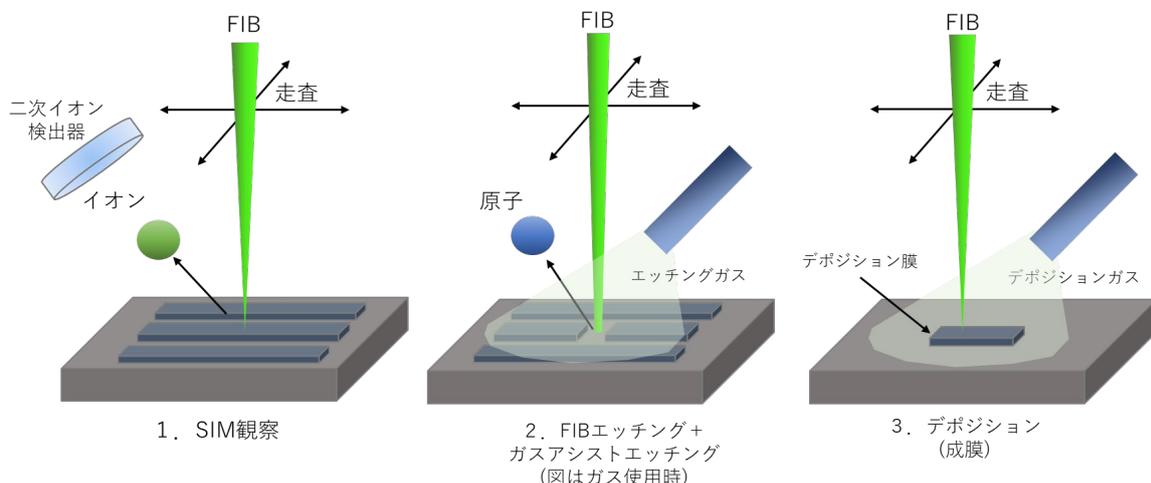
ノートPCやタブレットなどで採用が進む中型サイズのOLED（IT用OLED）については、スマートフォン用途のOLEDに対して大画面であり、その製造には画面内の輝度や色の均一性、耐久性等、小型OLEDと異なる面で高い性能と品質が求められています。

この度、IT用OLEDのフォトマスク生産に欠かせない機能*を備えた装置であり、修正位置精度の高さ、従来方式では実現が難しい加工端が滑らかで優れた仕上がりを実現するエッチング機能(余分な部分の除去)やデポジション機能(欠落部分の回路形成)等の微細加工性能、局所真空によるマスクの投入排出時間の短縮、省スペース性等の点から非常に高い評価を頂き、ご注文を頂戴しました。

当社グループは、今後も引き続き、半導体・ディスプレイの多様な進化を支える革新的な技術開発に取り組むと同時に、大きいなる志と溢れる情熱で、世界最高のイノベーションを創造し、社会に貢献してまいります。

*集束イオンビーム(Focused Ion Beam:FIB)装置の主な機能

1. SIM(Scanning Ion Microscope)観察：二次イオンを検出し、表面を観察します。
2. エッチング：フォトマスク上の微細パターンを削り(除去)します。
3. デポジション：ガスをマスク上で反応させ、微細なパターンを成膜します。



以上